

お客様各位

「VACUUM 2019 真空展」 出展者セミナー講演

東京電子株式会社

弊社ではこのたび【VACUUM 2019 真空展】にて、下記のとおり出展することになりました。
この機会に皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【日時】 2019年9月4日（水）～ 6日（金）：10:00～17:00

【弊社展示ブース】 小間番号：V-30

【会場場所】 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1
パシフィコ横浜 展示ホールD

弊社ブースの注目製品として、下記を展示致します。

【HF-HiPIMS 用パルス電源】

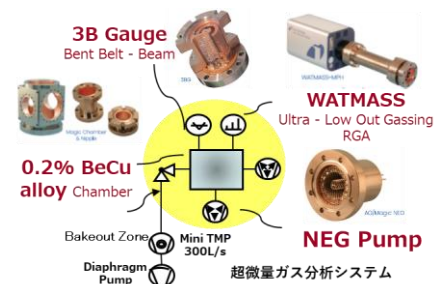
高密度着性、高硬度、高平滑性が求められるハードコーティング、バリア膜、赤外線デバイス等の光の透過を確実にしなければならない反射防止膜などの用途向けスパッタ成膜の手法である HiPIMS (Hi-Power Impulse Magnetron Sputtering) が注目を浴びています。弊社の HF-HiPIMS 用パルス電源は、スパッタリングの最大の課題であるアーク異常放電を抑制する機能および、HiPIMS の最大の課題である成膜レートを向上させる機能（特許取得済）を備えた他社にはない特長を持った画期的な製品です。



HF-HiPIMS電源

【超微量ガス分析装置】

MEMS やライフサイエンスデバイス、あるいは半導体などの封止デバイスには非常に高い信頼性が求められます。その信頼性を担保するには、デバイス内の超微量リーク検査が必須となっています。弊社の WATMASS を中心とした超微量ガス分析装置では、リーク量 $10^{-16} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ の計測が可能であり、この値の検出は世界でも類を見ない性能です。



出展者セミナーで講演を行います。

【日時】 2019年9月5日（木）13:30～14:10（No：V-7）

【タイトル】 アーク抑制型 HiPIMS 電源の開発

【日時】 2018年9月5日（木）14:30～15:10（No：V-8）

【タイトル】 超高感度 質量ガス分析装置 WATMASS-MPH システム